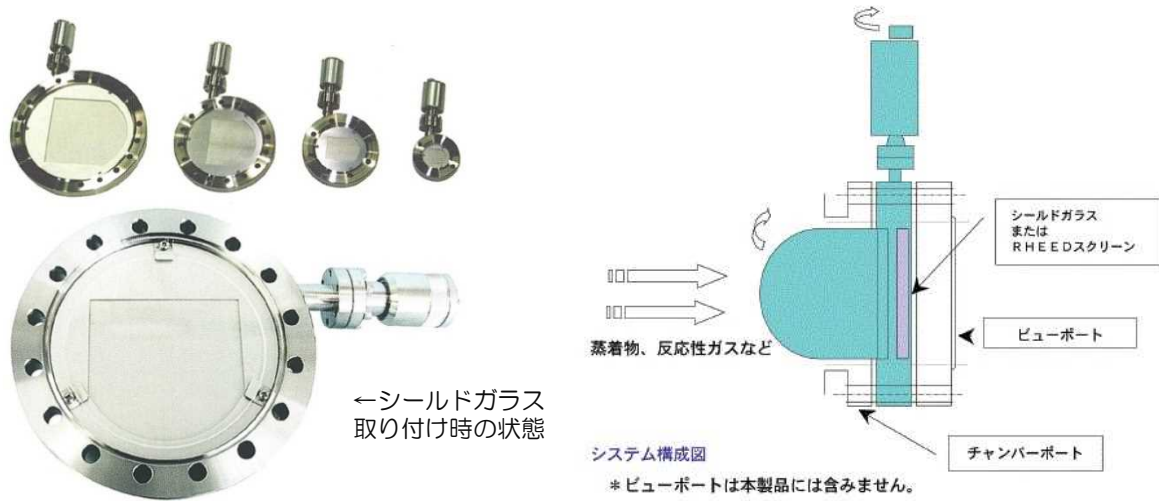


# ビューポートシャッター

## SFシリーズ

超小型  
回転導入機ビューポート  
シャッターロードロック  
ハッチ

簡易型XY機構

Zステージ

XYZステージ

トランスファー  
ロードチャッキング  
トランスファータイミングリーク  
バルブインターロック  
バルブ

### 概要

蒸着、スパッタ、MBE、CVDなどの成膜プロセスや有機ガスを含むプロセス中で問題となるビューポートへの成膜・ダメージを防止します。

### 特徴

1. コンフラットフランジ仕様により、MBE装置などの各種超高真空装置に使用可能です。
2. 回転導入機も200℃ベーキング対応のRFTシリーズを使用しており、高温ベーキングが可能です。
3. φ70CF～φ203CFに対応しています。
4. ほぼ隙間なく閉じることができ、高蒸気圧の試料にも効果があります。
5. オプションでシールドガラスやRHEEDスクリーンの装着も可能です。
6. 簡単な組み替えで開閉方向を変更できます。
7. 特殊サイズフランジの製作もしています。ご相談下さい。

### 仕様

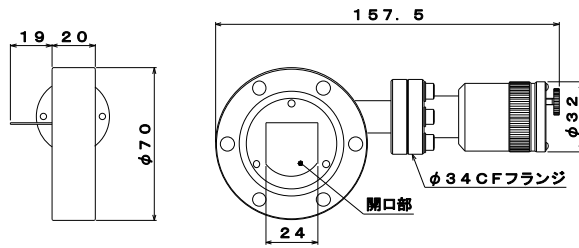
型式	フランジ	質量 (g)	共通仕様
SF70	φ70CF	650	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主な材質 : SUS304</li> <li>• 許容加熱温度 : 200℃</li> <li>• リーク量 : 6.7×10<sup>-11</sup> Pa・m<sup>3</sup>/sec 以下</li> <li>• 使用回転導入機 : RFT34B-VP (マグネットカップリング)</li> </ul>
SF114	φ114CF	1200	
SF152	φ152CF	1600	
SF203	φ203CF	2750	

### オプション

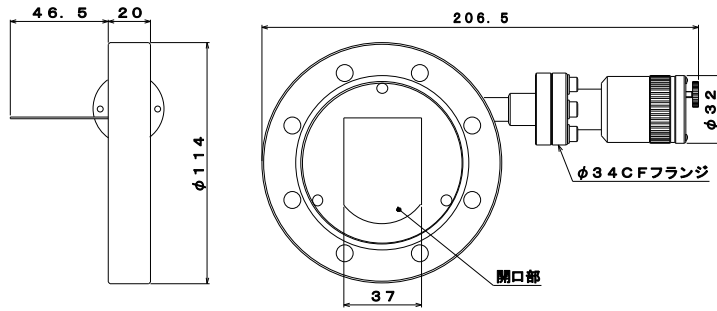
シールドガラス 取付金具付き	蒸着などその場で目視観測が必要な場合はシャッターフラップとビューポートの間にシールドガラスを装着することで蒸着物がビューポートへ付着しません。 交換用にシールドガラス単品の販売もしています。 SF70用 (φ33mm t=1mm)      SF114用 (φ63mm t=2mm) SF152用 (φ101mm t=2mm)      SF203用 (φ132mm t=5mm)
260℃高温仕様	260℃高温対応の回転導入機を使用します。 200℃以上の高温ベーキングが必要な場合はこちらのオプションを選択して下さい。
圧空作動	許容加熱温度 (アクチュエーター部) : 60℃ 駆動圧力 : 0.25～0.7MPa 配管接続 : φ4チューブワンタッチ継ぎ手
フラップ開閉方向	通常はフラップの回転軸を水平にすると、回転導入機は右上側になります。 回転導入機を左上側に取り付ける場合はこちらのオプションを選択して下さい。

# 外観寸法図

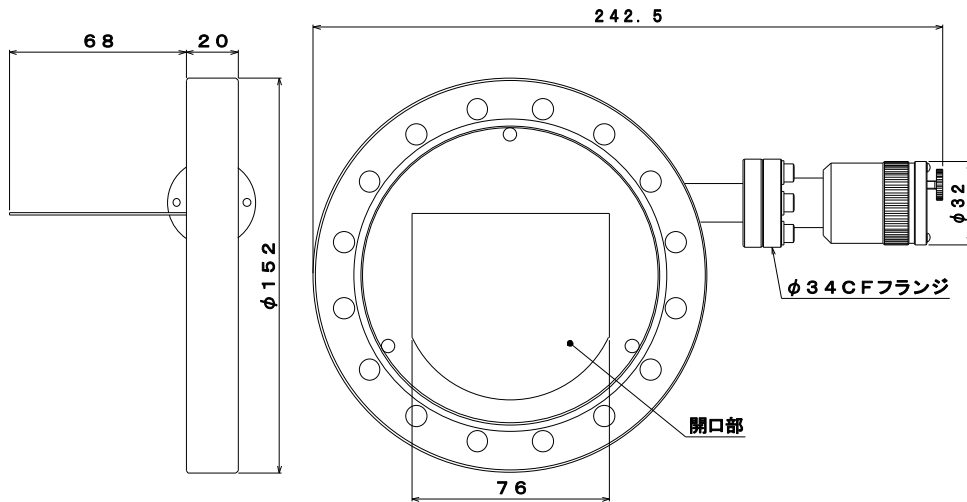
SF70



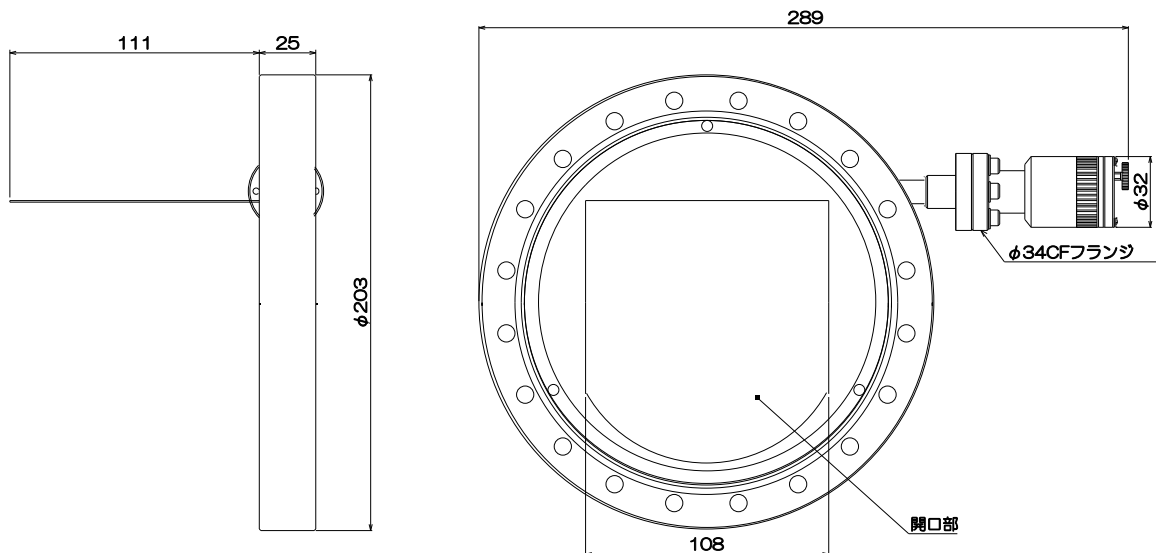
SF114



SF152



SF203



\* 改良のため予告なく仕様変更することがあります。

[www.arios.jp](http://www.arios.jp)

Vacuum & Plasma **ARIOS**

**アリオス株式会社**

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-2-20  
TEL 042(546)4811 FAX 042(546)4814  
E-mail : info@arios.co.jp